Термоградиентный концентрационный эффект в биполярном полупроводнике при увлечении носителей тока фононами

© А.М. Конин

Институт физики полупроводников, 2600 Вильнюс, Литва

(Получена 3 июня 1996 г. Принята к печати 16 сентября 1996 г.)

Теоретически исследовано влияние "термоувлечения" электронно-дырочных пар фононами на распределения концентраций носителей тока в полупроводниковом образце при поперечном градиенте температуры решетки. Рассмотрен наиболее интересный случай максимальной ассиметрии граничных условий и толщин образца, близкой к диффузионной длине. Показано, что наличие увлечения приводит к изменению зависимости полной концентрации от координаты с возрастающей на убывающую и, наоборот, к зависимости от направления градиента температуры, а также к значительному количественному перераспределению концентрации по сечению образца.

Поперечный термоградиентный концентрационный (ТГК) эффект в полупроводнике с собственной проводимостью был теоретически и экспериментально исследован в работе [1]. Расчет распределения неравновесной концентрации электронно-дырочных пар (ЭДП) с учетом возникающих термоэлектрических полей был проведен по схеме [2], причем получено хорошее совпадение теоретических и экспериментальных результатов, что безусловно говорит в пользу предложенной в [2] теоретической модели.

Однако в [1,2] был рассмотрен случай, когда отсутствует влияние анизотропной части функции распределения фононов на анизотропию функций распределения электронов и дырок, т.е. "термоувлечение" ЭДП фононами [3]. Это предположение справедливо для широкозонных полупроводников при относительно высоких температурах [3]. В узкозонных полупроводниках при относительно низких температурах и слабом рассеянии фононов на дефектах вполне реально значительное термоувлечение ЭДП фононами [3], которое приводит к значительному увеличению коэффициентов термоэдс электронов и дырок и, следовательно (см. [2]), может существенно изменить пространственное распределение ЭДП в кристалле.

Развитию предложенной в [1] модели на случай термоувлечения ЭДП фононами и расчету распределения концентраций носителей тока в полупроводнике при поперечном градиенте температуры решетки и посвящена настоящая работа.

В дальнейшем рассмотрим область температур, когда выполняется условие $\nu_{ff} \gg \nu_{fe}$ [3], где ν_{ff} — частота столкновений фононов с фононами, ν_{fe} — частота столкновений фононов с носителями тока. Это позволяет, с одной стороны, рассматривать невырожденные полупроводники с собственной проводимостью, в которых концентрационные эффекты максимальны. С другой стороны, фононы в этом случае являются объемным энергетическим резервуаром, так как их теплопроводность значительно больше электронной, а длина свободного

пробег значительно меньше тоолщины полупроводника [3].

Согласно [3], термоувлечение имеет место при условии

$$K_{n(p)} = \frac{es^2}{\mu_{n(p)}T\nu_{fd}} \gg 1, \qquad (1)$$

где $K_{n(p)}$ — коэффициент увлечения электронов (дырок), $\mu_{n(p)}$ — подвижность электронов (дырок), s — скорость звука в полупроводнике, e — заряд дырки, T — температуры решетки, ν_{fd} — частота столкновений фононов с дефектами.

Вычислив в общем случае кинетические коэффиценты [3] и разделив, согласно [2], коэффициенты термоэдс на два слагаемых, один из которых обусловлен градиентом химического потенциала, а другой является собственно термодинамической "внешней" силой, находим

$$\mathbf{j}_{n} = en\mu_{n} \Big(\mathbf{E} + \frac{T}{en} \nabla n - \alpha_{n}^{0} \nabla T - \Big(\alpha_{n}^{1} - \frac{1}{e} K_{n} \Big) \nabla T \Big),$$
$$\mathbf{j}_{p} = ep\mu_{p} \Big(\mathbf{E} - \frac{T}{ep} \nabla p - \alpha_{p}^{0} \nabla T - \Big(\alpha_{p}^{1} + \frac{1}{e} K_{p} \Big) \nabla T \Big), \quad (2)$$

где n(p) — концентрация электронов (дырок), **Е** — полное электрическое поле,

$$\alpha_n^0 = -\frac{1}{e} \left(\frac{F_n}{T} - \frac{3}{2} \right), \quad \alpha_n^1 = -\frac{1}{e} \left(q_n + \frac{5}{2} - \frac{F_n}{T} \right),$$

$$\alpha_p^0 = \frac{1}{e} \left(\frac{F_p}{T} - \frac{3}{2} \right), \quad \alpha_p^1 = \frac{1}{e} \left(q_p + \frac{5}{2} - \frac{F_p}{T} \right), \quad (3)$$

 F_n , F_p — квазиуровни Ферми электронов и дырок, q_n , q_p — параметры, характеризующие механизмы релаксации импульса электронов и дырок [4].

Как видно из формул (2), наличие термоувлечения ЭДП фононами приводит к значительному увеличению термодинамической внешней силы, которая и создает неравновесные носители тока. С другой стороны, неоднородное равновесное распределение ЭДП от коэффициентов увлечения $K_{n,p}$ вообще не зависит. т.е. остается прежним [1].



Рис. 1. Распределение концентрации ЭДП по толщине образца InSb при $\Delta T = 10$ K, $T_0 = 100$ K, $S_- = 0$, $S_+ \rightarrow \infty$ и K: I = 0, 2 = 100, 3 = 400.

Рассмотрим пластину полупроводника, поверхность x = a которой находится в тепловом контакте с термостатом с температурой T_+ , а поверхность x = -a — с термостатом с температурой T_- . Предположим, что толщина образца значительно больше длины остывания электронв (дырок) [4]. Тогда температуры всех квазичастиц совпадают [5] и

$$T(x) = T_0 + \frac{\Delta T}{2} \frac{x}{a},\tag{4}$$

где $T_0 = \frac{1}{2} (T_+ + T_-), \ \Delta T = T_+ - T_-, \ 2a$ — толщина образца.

Проводя для собственного полупроводника итерационную процедуру по предложенной в [2] схеме и учитывая условие $j_n^x + j_n^x = 0$ [6], получаем

$$j_n^x = \frac{eDN_0}{\lambda} \left[\frac{d\tilde{\nu}}{d\xi} + 2\varphi\tilde{\nu} + \beta \cdot e^{\alpha\xi} \right], \tag{5}$$

где $\xi = \frac{x}{\lambda}$, $u = \frac{a}{\lambda}$, $\alpha = \frac{E_g \Delta T}{4uT_0^2}$, $\varphi = (q_n + q_p + K + 2)\frac{\Delta T}{8uT_0}$, $\tilde{\nu} = \frac{\Delta n}{N_0}$, $K = K_n + K_p$, $\beta = 2\varphi + \alpha + \frac{3}{4}\frac{\Delta T}{uT_0}$, $D = \frac{2\mu_n\mu_p}{\mu_n+\mu_p}\frac{T_0}{e}$ — амбиполярный коэффициент диффузии, Δn — концентрация неравновесных ЭДП, λ — диффузионная длина, τ — время жизни ЭДП, N_0 — равновесная концентрация носителей при x = 0. Зависимость равновесной концентрация

$$n_0(\xi) = N_0 \mathrm{e}^{\alpha \xi}.\tag{6}$$

Решив диффузионное уравнение [6]

$$\frac{1}{e}\frac{dj_n^x}{dx} - \frac{\Delta n}{\tau} = 0,$$
(7)

для полной концентрации $\nu = \frac{n_0(\xi) + \Delta n}{N_0}$ получаем

$$\nu = \frac{\beta}{1 - \alpha(2\varphi + \alpha)} [A_1 e^{r_1 \xi} + A_2 e^{r_2 \xi} + \alpha e^{\alpha \xi}] + e^{\alpha \xi}, \quad (8)$$

где $r_1 = -\varphi + \sqrt{\varphi^2 + 1}, \quad r_2 = -\varphi - \sqrt{\varphi^2 + 1}.$

Физика и техника полупроводников, 1997, том 31, № 6



Рис. 2. Распределение концентарции ЭДП по толщине образца InSb при $\Delta T = -10$ K, $T_0 = 100$ K, $S_- = 0$, $S_+ \rightarrow \infty$ и K: I = 0, 2 = 100, 3 = 400.

Константы А_{1,2} находим из граничных условий

$$\frac{1}{e}j_n^x\big|_{x=\pm a} = \mp S_{\pm}\Delta n\big|_{x=\pm a},\tag{9}$$

где S_{\pm} — скорость поверхностной рекомбинации (СПР) на гранях $x = \pm a$ образца.

Для наиболее интересного случая максимальной асимметрии граничных условий ($S_{-}=0, S_{+} \rightarrow \infty$) $A_{1,2}$ имеют вид

$$A_{1} = -\frac{\alpha r_{1} \exp(\alpha - r_{2})u + \exp(r_{2} - \alpha)u}{r_{1} \exp(r_{1} - r_{2})u - r_{2} \exp(r_{2} - r_{1})u},$$

$$A_{2} = \frac{\alpha r_{2} \exp(\alpha - r_{1})u + \exp(r_{1} - \alpha)u}{r_{1} \exp(r_{1} - r_{2})u - r_{2} \exp(r_{2} - r_{1})u}.$$
 (10)

Результаты вычисления по формулам (8), (10) распределения концентрации ЭДП в образцах InSb толщиной 2λ приведены на рис. 1 и 2.

Как видно из рис. 1, в отсутствие увлечения (кривая 1) под действием потока тепла фононов, или, иначе говоря, термодинамической внешней силы, носители сносятся с холодной грани $x = -\lambda$ с малой СПР. При этом полная концентрация на холодной грани увеличивается, а ее зависимость от x остается, как и равновесной, монотонно возрастающей. Заметим, что в достаточно тонких образцах ($2a \ll \lambda$) в отсутствие увлечения полная концентрация, как следует из (8), (10), практически не зависит от координаты и равна равновесной концентрации ЭДП на грани с большой СПР.

При наличии увлечения (рис. 1, кривые 2, 3) под действием значительной термодинамической внешней силы вынос ЭДП на холодную грань возрастает, а зависимость полной концентрации от координаты x становится монотонно убывающей. Значительно возрастает также электропроводность образца: при K = 100 — в 1.9 раз, а при K = 400 — в 4.55 раз по сравнению с равновесной.

По тем же причинам при изменении знака градиента температуры (рис. 2) происходит снос ЭДП к грани

с большой СПР, где они эффективно рекомбинируют. Вследствие этого, как в объеме, так и на "теплой" поверхности $x = -\lambda$ имеет место уменьшение концентрации ЭДП. Рост увлечения приводит как к изменению функциональной зависимости n(x) с убывающей (кривая I) на возрастающую (кривые 2, 3), так и к значительному уменьшению электропроводности образца: при K = 100 — в 1.7 раз, при K = 400 — в 4 раза.

Таким образом, увлечение ЭДП фононами приводит к значительному изменению распределения концентрации носителей тока под действием градиента температуры решетки.

Список литературы

- [1] А.М. Конин, А.П. Сашук. ФТП (направлено в печать).
- [2] Ю.Г. Гуревич, О.Л. Машкевич. ФТП, 24, 1327 (1990).
- [3] Ф.Г. Басс, В.С. Бочков, Ю.Г. Гуревич. Электроны и фононы в ограниченных полупроводниках (М., 1984).
- [4] Ф.Г. Басс, В.С. Бочков, Ю.Г. Гуревич. ФТП, 7, 3 (1973).
- [5] В.С. Бочков, Ю.Г. Гуревич. ФТП, 17, 728 (1983).
- [6] А.М. Конин, В.Г. Рудайтис, А.П. Сашук. Лит. физ. сб., 30, 285 (1990).

Редактор В.В. Чалдышев

Thermogradient concentration effect in a bipolar semiconductor under charge carrier drag by phonons

A.M. Konin

Institute of Physics of Semiconductors, 2600 Vilnius, Lithuania